附件 1

JEM-F200 场发射透射电子显微镜功能参数

一、基本功能

1.可进行微观结构分析，拍摄明场像、暗场像、高分辨像、扫描透射高角环形暗场像；

2.可进行选区电子衍射和会聚束电子衍射，分析微区晶体结构、样品厚度以及材料应变场；

3.配备能谱仪，可进行微区成分分析。

二、技术指标

1.TEM 点分辨率：0.23 nm@200 kV，线分辨率：0.10 nm@200 kV；

2.STEM-HAADF 分辨率：0.16 nm@200 kV；

3.能谱仪（EDS）能量分辨率：136 eV。

三、仪器特色

1.搭载冷场发射电子枪，最高分辨率达 0.1 nm；

2.能够实现自动进出样品杆；

3.配有双探头超级能谱仪（探头面积 200 mm^2），能够在任意样品倾角下实现快速高精度的 EDS 分析；

4.搭载 Gatan RIO16 相机。